

平成 19 年度実証講義時間表

A. 講義（定員 20 名）

A-1. マイクロ加工コース

日程	講義室	9:50～11:50
10月26日（金）	山口大学 VBL セミナー室	微細加工－エッチング技術－ ドライエッチング装置のアレンジ

A-2. 真空プロセスコース

日程	講義室	12:50～14:50	15:00～17:00
10月26日（金）	山口大学 VBL セミナー室	薄膜形成プロセス技術 薄膜形成装置のアレンジ（1）－手法－	薄膜形成プロセス技術 薄膜形成装置のアレンジ（2）－演習－

B. 実践型長期実習（定員 3 名）

※企業の都合により多少日程調整などの対応も考えられるのでお問い合わせください。

B-1. 真空工学コース：真空装置の分解・組立

日程	実習室	10:00～17:00
10月18日（木）	山口大学工学部 中核人材実習室	<ul style="list-style-type: none"> ・第1ステージ：分解 ・第2ステージ：組立・性能 真空装置や真空部品のしくみや構成並びに取り扱い方を理解し習得するために、真空装置(小型の単元スパッタ装置)の分解・組立実習を行います。
10月19日（金）		
10月20日（土）		

B-2. 真空プロセスコース：波長選択ミラーの作製（スパッタ成膜装置を用いた薄膜形成と薄膜評価）

日程	実習室	10:00～17:00
11月1日（木）	山口大学工学部 中核人材実習室	<ul style="list-style-type: none"> ・第1ステージ：シミュレーションによる設計と作製方法および評価方法の習得 ・第2ステージ：単層膜の作製と光学評価 ・第3, 4ステージ：波長選択ミラーの作製 波長選択ミラーの作製を実施することで、「薄膜デバイス設計」、「薄膜・多層膜形成」、「作製薄膜の評価」に係る手法・ノウハウや、装置のトラブル対策に係る手法・ノウハウと考え方について実習します。
11月2日（金）		
11月9日（金）		
11月10日（土）		
11月16日（金）		
11月17日（土）		

B-3. マイクロ加工コース：マイクロインダクタの作製（デバイス設計とフォトリソグラフィを用いた微細加工）

日程	実習室	10:00～17:00
11月30日（金）	山口大学 VBL クリーンルーム	<ul style="list-style-type: none"> ・第1ステージ：作製方法および評価方法の習得 ・第2ステージ：試作素子の評価 ・第3, 4ステージ：性能指数の向上 微細加工技術を利用するテーマを設定し実習を行ないます。例として、「マイクロインダクタの作製」を準備しています。シミュレーションによる設計とリソグラフィ技術による作製を行ないます。
12月1日（土）		
12月7日（金）		
12月8日（土）		
12月14日（金）		
12月15日（土）		